

電気学会 センサ・マイクロマシン部門大会 第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催シンポジウム、
応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会主催シンポジウム、および
http://www.sensorsymposium.org/index_j.html

-技術展示出展者募集のご案内-

拝啓 ますますご清栄にてご活躍の事とお慶び申し上げます。

電気学会センサ・マイクロマシン部門(E部門)では本年より部門大会として「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムを開催します。本シンポジウムは、広く関連学協会のご協力をいただき、従来の学会の枠を超えた各分野の研究者が集う、センサ・マイクロマシン・応用システムをテーマとした学術集会です。

同会場においては、日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」、応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会主催「集積化 MEMS シンポジウム」が同時に開催されます。

前回の第29回シンポジウム(2012年10月22日～24日 北九州国際会議場・西日本総合展示場にて開催)は、2件のプレナリ招待講演、66件の一般講演、34件の企画セッション講演、および72件のポスター発表で構成され、同時開催シンポジウムと併せて、618名のご参加を賜りました。

また、前回に引き続き、電子情報通信学会、日本材料学会、エレクトロニクス実装学会との協力による企画セッションも予定しています。

例年同様、同会場にて併設技術展示を予定しております。つきましては、御社のご協力によって、センサ、MEMS デバイス関係およびその応用システム製品、各種設計ツール、製造装置、テスト評価装置、測定機器、実装技術関連、材料、書籍等を広く参加者にご紹介いただきたいと思います。

本年は、技術展示出展小間を2種類用意いたしました。またアカデミック展示として大学関係諸機関による展示も募集いたします。概要及び出展申込書を同封いたしましたので、ぜひご検討下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
実行委員長 桑野 博喜(東北大学)

電気学会 センサ・マイクロマシン部門大会 第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

-アカデミック展示のご案内-

センサシンポジウムでは例年併設技術展示会を開催しておりますが、ご希望にお応えするため、大学関係者の方に、アカデミック展示のスペースをご用意させていただくことになりました。

展示小間はテーブル形式のみで、テーブルの後ろにボード(幅1.8m)がありますので、パネルであれば2枚の掲示が可能です。

通常の出展料は10万円ですが、アカデミック展示ということで、実費(5万円)でご提供いたします。

ぜひこの機会に、研究成果の発表の場として、ご活用くださいますようよろしくご検討ください。

なお、スペースに限りがありますので、ご希望にそえない場合もありますが、あらかじめご了承ください。

技術展示出展申込書にご記入の上お申し込みください。なお、ご不明の点は下記センサシンポジウム事務局までお問い合わせください。

第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」

シンポジウム事務局

株式会社セミコンダクタポータル内

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22

赤坂ツインタワー東館17F

Tel: 03-3560-3565

sensorsympo_2013@semiconportal.com

開催概要

http://www.sensorsymposium.org/index_j.html

会議の名称

Future Technology From SENDAI

第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

The 30th SENSOR SYMPOSIUM on Sensors, Micromachines and Applied Systems

開催期日

平成25年11月5日(火)~7日(木)

開催場所

仙台国際センター <http://www.sira.or.jp/icenter/>

〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地 TEL: 022-265-2450

主催

電気学会 センサ・マイクロマシン部門

協力

応用物理学会集積化MEMS技術研究会

日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門

協賛(予定)

エレクトロニクス実装学会、応用物理学会、化学とマイクロ・ナノシステム研究会、計測自動制御学会、システム制御情報学会、次世代センサ協議会、精密工学会、センシング技術応用研究会、電気化学会、電子情報通信学会、日本機械学会、日本材料学会、日本真空協会、日本信頼性学会、日本生体医工学会、日本赤外線学会、日本ロボット学会、ニューセラミックス懇話会、BEANS 研究所、マイクロマシンセンター、レーザー学会、電気学会関連技術委員会

参加者数(予定)

500名

URL

<http://www.sensorsymposium.org/30/>

開催組織

実行委員長	桑野 博喜	東北大学
実行副委員長	三原 孝士	(一財)マイクロマシンセンター
実行委員会幹事	石井 仁	豊橋技術科学大学
副幹事	阪田 知巳	日本電信電話(株)
副幹事	古賀 章浩	(株)東芝
副幹事	原 基揚	東北大学
論文委員長	池原 毅	(独)産業技術総合研究所
副委員長	秦 誠一	名古屋大学
副委員長	安部 隆	新潟大学
副委員長	藤田 孝之	兵庫県立大学
併設行事担当委員長	磯部 良彦	(株)デンソー
会場委員長	小野 崇人	東北大学
財務委員長	野田 和俊	(独)産業技術総合研究所
副委員長	三林 浩二	東京医科歯科大学
広報担当	三田 吉郎	東京大学
機械学会シンポ担当	丸尾 昭二	横浜国立大学
応用物理学会シンポ担当	島内 岳明	(株)富士通研究所
材料学会企画セッション担当	松村 隆	電気通信大学
実装学会企画セッション担当	伊藤 高廣	九州工業大学
信学会企画セッション担当	松岡 俊匡	大阪大学
顧問	石田 誠	豊橋技術科学大学
	川原 伸章	(株)デンソー
	木股 雅章	立命館大学
	小寺 秀俊	京都大学
	庄子 習一	早稲田大学
	藤田 博之	東京大学
	益 一哉	東京工業大学
	町田 克之	NTTアドバンステクノロジー(株)

会議スケジュール(予定)

11/5 (火)	午前	開会式 招待講演			展示設営 (予定)
		電気学会 センサシンポジウム	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム		
	午後	電気学会 センサシンポジウム	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム		技術展示 (予定)
		合同ポスターセッション			
夜間	合同懇親会				
11/6 (水)	午前	招待講演			技術展示 (予定)
		電気学会 センサシンポジウム	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム	応用物理学会 集積化 MEMS シンポジウム	
	午後	電気学会 センサシンポジウム	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム	応用物理学会 集積化 MEMS シンポジウム	
		合同ポスターセッション			
夜間	ランプセッション(未定)				
11/7 (木)	午前	招待講演			技術展示 (予定)
		電気学会 センサシンポジウム	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム	応用物理学会 集積化 MEMS シンポジウム	
	午後	電気学会 センサシンポジウム	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム	応用物理学会 集積化 MEMS シンポジウム	
		閉会式			
		展示撤去(予定)			

技術分野

1	設計・製作技術、 材料	設計、解析、シミュレーション、材料、材料評価、デバイス評価、加工・プロセス技術、パッケージングとアセンブリ技術、マイクロ理工学(マイクロライボロジ、マイクロ・ナノ熱流体)、集積化 MEMS 技術、CMOS-MEMS 技術、テスト技術、信頼性評価技術、新分野・新領域(カーボンナノチューブ、量子効果センシング、各種走査プローブ顕微鏡、真空マイクロエレクトロニクス、分子機械)
2	MEMS/NEMS	アクチュエータ(電磁アクチュエータ、静電アクチュエータ、圧電アクチュエータ、高分子アクチュエータ、流体アクチュエータ、熱アクチュエータ、変位/力増幅機構、動力変換機構)、光マイクロシステム(光部品、光導波路、光通信システム、光集積回路、近接場光、フォトニッククリスタル、イメージセンサ)、RF-MEMS(RF 部品、RF 電力供給、RF-CMOS-MEMS 技術)、パワーMEMS(エネルギーハーベスティング、マイクロ発電、電力供給、マイクロタービン、マイクロスラスタ)、五感提示デバイス(触覚ディスプレイ等)、NEMS、ナノとのインターフェース
3	センサシステム	センサシステム(アレイ化センサ、集積化センサ、スマートセンサ、センサインターフェース回路、超低消費電力センサ、信号処理、ヒューマンインターフェース、ユビキタスシステム、テレメトリ、埋め込みモニタ)、センシングアルゴリズム(アクティブセンシング、センサフュージョン、生物機能応用センシング)、センサネットワーク、センサ応用(自動車、医療、ロボット、工業計測、福祉、環境、部屋・建物・都市インフラ、安全・安心)
4	フィジカルセンサ	機械量センサ(力、ひずみ、圧力、位置、加速度、速度、角速度、流速、流量、音、触覚、温度)、電気・磁気センサ(電圧、磁気)、光・放射線センサ(赤外線、可視光、紫外線、X線、γ線、粒子線)、センサ材料、新原理・新方式フィジカルセンサ
5	ケミカルセンサ	化学センシング原理、ガスセンサ、酵素センサ、イオンセンサ、匂いセンサ、味センサ、表面プラズモン、光ファイバーセンサ、マイクロ化学センサ、化学センサ用新技術(表面ナノ構造、自己修復技術、表面自己清浄、バイオミメティック)、ケモメトリクス論、新アルゴリズム応用化学センサ(ニューロ、ファジィ、遺伝的アルゴリズム、脳科学、センサフュージョン)、化学センサ応用(五感情報通信、嗅覚ディスプレイとVR、医用微小化学センサ)、使い捨て化学センサ技術、匂い源探知、時空間領域の化学センシング
6	バイオセンサ、 バイオマイクロ システム	Lab-on-chip、マイクロ化学システム(microTAS)、DNA チップ、PCR、生体分子デバイス、生体機能分子固定化技術、細胞操作、マイクロチャネル、マイクロリアクタ、体内埋め込みデバイス、ドラッグデリバリー、手術支援、遠隔地手術システム、カテーテル、カプセル内視鏡、再生医療、バイオセンサ、バイオチップ、創薬支援、ソフトアクチュエータ、BioMEMS、バイオハイブリッドデバイス、生体機械インターフェース

オーガナイズドセッション(電気学会センサシンポジウム)

企画セッション	<ul style="list-style-type: none"> ・ エレクトロニクス実装学会協力セッション ・ 日本材料学会協力セッション ・ 電子情報通信学会協力セッション ・ 他2件程度予定
---------	--

展示規定

展示内容 センサ、MEMS デバイス関係およびその応用システム製品、設計ツール、製造装置、測定機器、材料、実装技術関係、書籍、その他の展示

開催日程 11月5日(火) 設営・展示
(予定) 11月6日(水) 展示
11月7日(木) 展示・撤去

展示会規模 20小間(予定)

展示スペース

タイプ A. 小間

間口 1.8mx奥行 0.9mx高さ 2.1mの小間

2小間以上の使用も可能。

上記には以下のものが含まれます。

バックパネルおよびサイドパネル、社名板(スミ1色・統一書体、間口上部に設置)、基本照明、テーブル

タイプ B. テーブル形式

出展料 A: 小間 20万円/1小間(消費税を含む)
B: テーブル形式 10万円(消費税を含む)
アカデミック展示: 5万円(消費税を含む)

出展者特典 出展者バッジ(1社2名分)、論文集のダウンロード可能、ホームページへのバナー広告掲載

展示事務局 第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局
株式会社セミコンダクタポータル内
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22
赤坂ツインタワー東館 17F
Tel:03-3560-3565 Fax: 03-3560-3566
sensorsympo_2013@semiconportal.com

出展申込み

出展申込書に必要事項をご記入の上、事務局まで FAX またはメールでご送付ください。折り返し受領確認書を送信いたします。展示会場のスペースに限りがありますので、各出展申込者からのお申込み総小間数が募集小間数を越えた場合は、申込み小間数を調整することがありますので、予めご了承ください。

出展申込書は会議ホームページからダウンロード可能です。

http://www.sensorsymposium.org/index_j.html

申込み締切り 平成 25 年 9 月 20 日(金)(予定)

締切り前にお申込み小間総数が予定小間数に達した場合には、該当日を待たずにお申込みを締め切らせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

出展料の支払

出展料は、小間割り決定後、事務局より請求書を発行いたします。請求書の内容に応じて所定の口座にお振り込みください。

出展の取消

出展申込み後の取消をする場合は、決定後速やかに書面にて、事務局にご連絡ください。ただし、出展料の支払期限以降の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

注意事項

小間割通知

申込み締切り後、主催者は申込み小間数・出展物・展示スペースなどに基づいて小間の調整を行い、9月27日(金)(予定)までに配置を決定し、すみやかに出展者各位に平面図及び小間番号などの詳細を通知いたします。

搬入・搬出

搬入・搬出時間の詳細につきましては、後日ご連絡いたします。

小間内装飾

出展者は注意事項に留意して各自で小間内装飾を行って下さい。詳細は、展示事務局にご相談ください。

電気・備品等

電源・電気器具、備品関係(椅子等の家具類、植物・花、AV 機器等)のオプションのお申込みは、事務局にご相談ください。なお、基礎小間仕様以外の電気使用および追加電気工事費は出展料に含まれておりませんので、各社のご負担となり、後日請求とさせていただきます。

制限事項等

造形物の高さ制限、床工事、床荷重、危険物の持込み制限等、追ってご案内します。

保全と責任

出展者は、その出展物の運搬・搬入・展示中の不測の事故による損失、ならびに出展物により生じる人体の損害については、各自適切な管理を行ってください。

出展者が被った損失・災害に対して主催者は一切責任を負いません。また、天災・ストライキ等不可抗力による展示会の取り消しの場合、主催者はその責任を負いませんのでご了承ください。各出展者の責任において必要な損害保険をおかけください。

この規定に対する変更と追加

この開催規定が定めていない事項またはこの開催規定の条項について異議が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。また、本技術展示の目的のために必要と判断される場合は出展者に通知し、この規定を改定あるいは追補いたします。

THE 30th SENSOR SYMPOSIUM

on Sensors, Micromachines, and Applied Systems

第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局
株式会社セミコンダクタポータル内
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー東館 17F
Tel:03-3560-3565 Fax:03-3560-3566
sensorsympo_2013@semiconportal.com

第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 技術展示出展申込書

FAX 送信先 03-3560-3566

E-mail 送信先 sensorsympo_2013@semiconportal.com

年 月 日

出展社名	日本語	
	英語	
連絡先	住所 〒	
	電話	FAX
責任者	氏名	
	所属	
	電子メール	
担当者	氏名	
	所属	
	電話	FAX
	電子メール	
希望展示小間・テーブル	いずれかをお選びください。 <input type="checkbox"/> タイプ A. ()小間 <input type="checkbox"/> タイプ B. テーブル <input type="checkbox"/> アカデミック展示	
出展物概要	ご出展の製品等をご記入ください。	
使用予定電気容量	例: ノートPC、液晶ディスプレイなど 100V 電源 x 個 100V 電源 x 個 使用機器:	
展示設営業者	外部業者使用の場合にご記入ください。	
その他特記事項	必要備品(例: 椅子 x 脚数)、小間・テーブルの取り方、位置などのご希望があればご記入ください。	